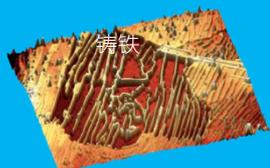
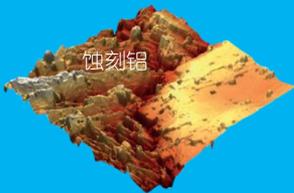
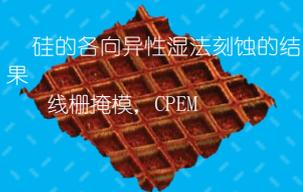


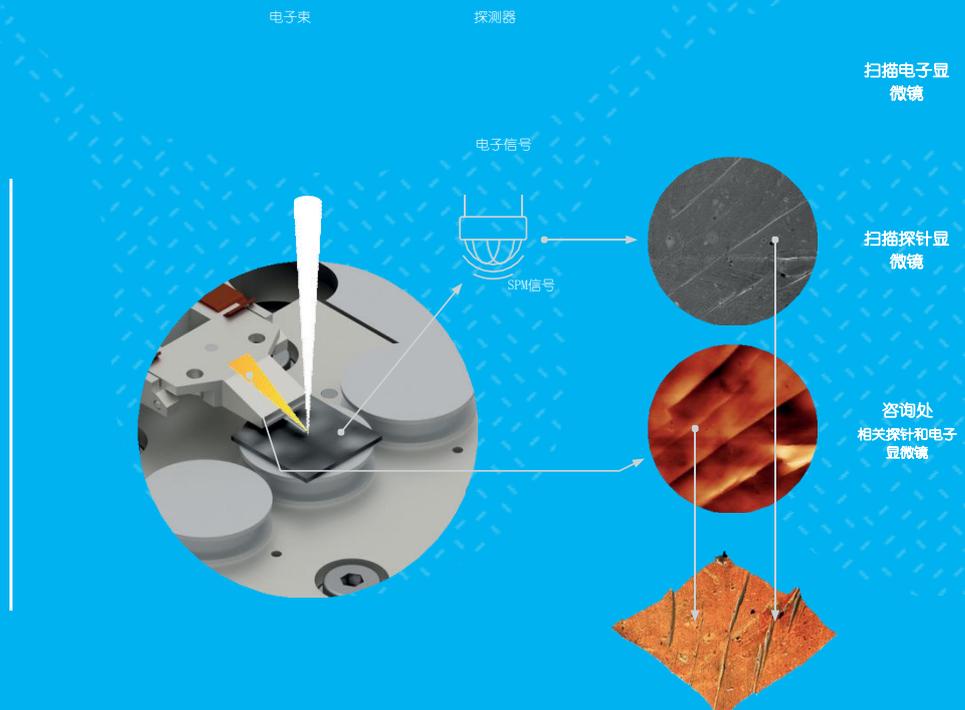
扫描探针显微镜设计用于轻松集成到电子显微镜中

- 表面结构的三维可视化
- 复杂表面特征 - 形貌，粗糙度，磁性，电导率，电性能等
- 精确的SPM尖端导航到SEM感兴趣的区域
- 用户友好的操作，轻松集成到SEM
- 广泛的SPM成像模式

探索各种应用



探索全新的相关探针和电子显微镜技术



Litef1a™

SPM/FIB/SEM-集成电路失效分析

相关探针和电子显微镜 (CPEM) 是一种结合扫描电子显微镜 (SEM) 和扫描探针显微镜 (SPM) 的新技术。集成电路中的目标层可以通过SEM和SPM在同一地点, 同时和相同的协调下进行分析系统。CPEM图像包含表面形貌信息以及典型的SEM细节。

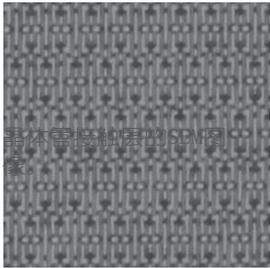
SPM / FIB / SEM技术的集成显著简化了用于故障分析, 质量控制和集成电路研发的去层过程。

我们的解决方案

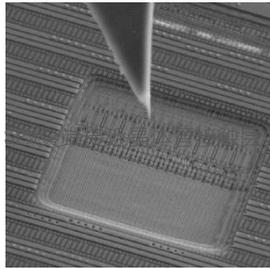
质量控制
去层后的平面性

精确的SPM尖端
导航

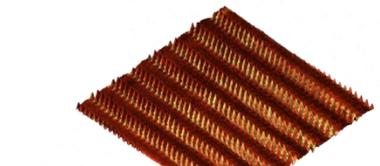
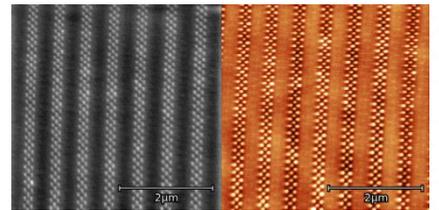
相关成像, 表面表征



判定
表面粗糙度

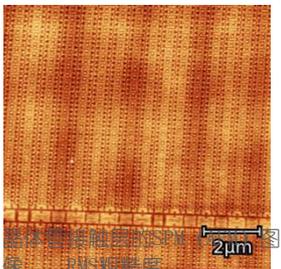


深度剖析



通孔层的SEM, SPM (SEM) 和CPEM图像。 RMS粗糙度为3.3nm。

3D逐层重建



判定
表面粗糙度
2.5纳米。

